

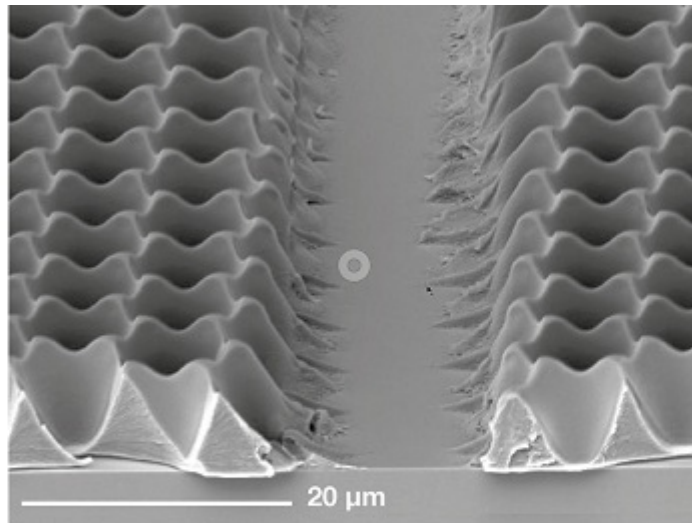
晶片纳米压印质保期多久


发布日期：2025-09-19 | 阅读量：94

EVG®6200NT特征：顶部和底部对准能力高精度对准台自动楔形补偿序列电动和程序控制的曝光间隙支持最新的UV-LED技术最小化系统占地面积和设施要求分步流程指导远程技术支持多用户概念（无限数量的用户帐户和程序，可分配的访问权限，不同的用户界面语言）敏捷处理和转换工具台式或带防震花岗岩台的单机版EVG®6200NT附加功能：键对准红外对准智能NIL® μ 接触印刷技术数据晶圆直径（基板尺寸）标准光刻：75至200mm柔软的UV-NIL \square 75至200毫米SmartNIL® \square 最多至150mm解析度 \square $\leq 40\text{nm}$ \square 分辨率取决于模板和工艺）支持流程：软UV-NIL \square SmartNIL®曝光源：汞光源或紫外线LED光源对准：软NIL \square $\leq \pm 0.5\mu\text{m}$ \square SmartNIL® \square $\leq \pm 3$ 微米自动分离：柔紫外线NIL \square 不支持 \square SmartNIL® \square 支持工作印章制作：柔软的UV-NIL \square 外部 \square SmartNIL® \square 支持纳米压印是一种用于大规模制造微米级和纳米级结构的低成本的技术，大批量替代光刻技术。

晶片纳米压印质保期多久

工艺结果：
在多晶硅上压印蜂窝状图案
(使用EVG纳米压印设备)



 岱美仪器技术服务（上海）有限公司
键合机、光刻机、膜厚仪、干涉仪、轮廓仪、隔振台、位移传感器

NIL300mmEV集团企业技术开发和知识产权总监MarkusWimplinger表示 \square “EVG的NILPhotonics能力中心成立于2014年，为光刻/纳米压印技术供应链中的各个合作伙伴和公司与EVG合作提供了一个开放式的创新孵化器，从而缩短创新光子器件和应用的开发周期和上市时间。我们很高兴与肖特公司合作，证明EVG光刻/纳米压印技术解决方案的价值，不仅有助于新技术和新工艺的开发，还能够加速新技术和新工艺在大众市场中的采用。我们正在携手肖特开展的工作，彰显了光刻/纳米压印技术设备和工艺的成熟性，为各种令人兴奋的基于光子学的新产品和新应用的300-mm制造奠定了基础 \square ”SCHOTTRealView™高折射率玻璃晶圆是领仙AR/MR设备的关键组件，已经实现了批量生产。产品组合提供了高达，支持深度沉浸的AR/MR应用，视野更广，高达65度。在与增强现实硬件制造商进行多年研发之后，肖特在2018年推出了第一

代SCHOTTRealView™这款高端产品在上市一年后便荣获了享有盛誉的2019年SID显示行业奖[SIDDisplayIndustryAward2019]关于肖特肖特是特种玻璃、微晶玻璃和相关高科技材料领域的领仙国际技术集团。公司积累了超过130年的经验，是众多行业的创新合作伙伴EVG7200LA纳米压印质保期多久HERCULES NIL 300 mm提供市场上最先近纳米压印功能，具有较低的力和保形压印，快速高功率曝光和平滑压模分离。

EVG510 HE 热压系统




岱美仪器技术服务(上海)有限公司
键合机、光刻机、膜厚仪、干涉仪、轮廓仪、隔振台、位移传感器

纳米压印微影技术可望优先导入LCD面板领域原本计划应用在半导体生产制程的纳米压印微影技术(Nano-ImpLithography[NIL])现将率先应用在液晶显示器(LCD)制程中[NIL为次世代图样形成技术。据ETNews报导，南韩显示器面板企业LCD制程研发小组，未确认NIL设备实际图样形成能力，直接参访海外NIL设备厂。该制程研发小组透露，若引进相关设备，将可提升面板性能。并已展开具体供货协商[NIL是以刻印图样的压印机，像盖章般在玻璃基板上形成图样的制程。在基板上涂布UV感光液后，再以压印机接触施加压力，印出面板图样。之后再经过蚀刻制程形成图样[NIL可在LCD玻璃基板上刻印出偏光图样，不需再另外贴附偏光薄膜。虽然在面板制程中需增加NIL[蚀刻制程，但省落偏光膜贴附制程，可维持同样的生产成本。偏光膜会吸收部分光线降低亮度。若在玻璃基板上直接形成偏光图样，将不会发生降低亮度的情况。通常面板分辨率越高，因配线较多，较难确保开口率(ApertureRatio)]

EVG®520HE特征：用于聚合物基材和旋涂聚合物的热压印和纳米压印应用自动化压花工艺EVG专有的独力对准工艺，用于光学对准的压印和压印气动压花选项软件控制的流程执行EVG®520HE技术数据加热器尺寸：150毫米，200毫米最大基板尺寸：150毫米，200毫米最小基板尺寸：单芯片，100毫米最大接触力[10][20][60][100kN最高温度：标准[350°C]可选[550°C]粘合卡盘系统/对准系统150毫米加热器[EVG®610][EVG®620][EVG®6200]200毫米加热器[EVG®6200][MBA300]的SmartView®NT真空：标准：0.1毫巴可选[0.00001mbarEVG先进的多用户概念可以适应从初学者到**级别的所有需求，因此使其成为大学和研发应用程序的理想选择。

EVG620 NT Smart NIL紫外光纳米压印系统



 岱美仪器技术服务(上海)有限公司
键合机、光刻机、膜厚仪、干涉仪、轮廓仪、隔振台、位移传感器

EVG®770分步重复纳米压印光刻系统分步重复纳米压印光刻技术，可进行有效的母版制作。EVG770是用于步进式纳米压印光刻的通用平台，可用于有效地进行母版制作或对基板上的复杂结构进行直接图案化。这种方法允许从最大50mmx50mm的小模具到最大300mm基板尺寸的大面积均匀复制模板。与钻石车削或直接写入方法相结合，分步重复刻印通常用于有效地制造晶圆级光学器件制造或EVG的SmartNIL工艺所需的母版。EVG770的主要功能包括精确的对准功能，完整的过程控制以及可满足各种设备和应用需求的灵活性。EVG®770是分步重复纳米压印光刻系统，使用分步重复纳米压印光刻技术，可进行有效的母版制作。EV Group纳米压印有哪些品牌

EVG紫外光纳米压印系统还有EVG®7200LA、HERCULES®NIL、EVG®770、IQAligner®等。晶片纳米压印质保期多久

在EVG的NIL Photonics®解决方案支援中心，双方合作研发用于制造光学传感器的新材料，以及适用于大众化市场的晶圆级光学元件。（奥地利）与WINDACH（德国），2019年11月27日——EV集团(EVG)这一全球领先的为微机电系统、纳米技术与半导体市场提供晶圆键合与光刻设备的供应商，金天宣布与高科技工业粘合剂制造商DELO在晶圆级光学元件(WLO)领域开展合作。这两家公司均在光学传感器制造领域处于领先地位。它们的合作将充分利用EVG的透镜注塑成型与纳米压印光刻(NIL)加工设备与DELO先进的粘合剂与抗蚀材料，在工业，汽车，消费类电子产品市场开发与应用新型光学设备，例如生物特征身份认证，面部识别。目前双方正在EVG的NIL Photonics®解决方案支援中心（位于EVG总部，奥地利Florian以及DELO在德国Windach的总部展开合作。双方致力于改善与加快材料研发周期。EVG的NIL Photonics解决方案支援中心为NIL供应链的客户与合作伙伴提供了开放的创新孵化器，旨在通过合作来缩短创新设备与应用的研究与推广周期。该中心的基础设施包括领先技术的洁净室与支持NIL制造的主要步骤的设备，例如分步重复母版，透镜模制，以及EVG的SmartNIL®技术，晶圆键合与必要的测量设备。晶片纳米压印质保期多久

岱美仪器技术服务(上海)有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展

过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在上海市等地区的仪器仪表中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和与大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同岱美仪器技术服务供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！